立ち上げ

- 1. Ar ガスの2次系の圧力を0.15 MPa に調整する。
- 2. 本体正面右下の電源を入れる。パソコンは自動的に立ち上がるので、そのまま待つ。
- Ar ボンベにホースを接続した直後はホース中に空気が残っているので、Ar ガス流量ボタンを押し、ホー ス内の空気を抜く。

(30分間。理想は1時間)

試料ホルダーの取り外し

- 試料をセットした試料ホルダーに試料ホルダー交換棒を 付ける。
- <u>試料交換ボタンを押すと表示される試料交換ダイアログ</u>
   より Vent ボタンを押してチャンバーを大気圧にする。
- チャンバーが大気圧に達したのを確認し、扉をチャンバーから引き出す。
- 4. 試料ホルダーを試料ステージにセットする。
- 5. 試料ステージロックレバーを反時計回りに回し、試料を 固定する。
- 6. 試料ホルダー交換棒を試料ホルダーより取り外す。
- 7. ベルトカセットを試料ステージにセットする。
- 扉を閉じて、チャンバーを排気する。TMP の運転音がする まで、扉は押さえておく。
- 9. モニタ画像でベルトと試料の隙間を確認し、隙間が 170 倍で 1~2 mm になるように高さ調整ボタンで調整する。
- **10**. チャンバーの真空度が 10<sup>-4</sup> Pa 以下になるまで待つ。

## Ar ガス最適化

- 希望の加速電圧を設定する。

   (加速電圧が高いほど、試料へのダメージはおおきくなる。
   せいぜい 8 kV。)
- 2. 操作画面ガス最適化を選択する。
- 条件設定画面で、始点ガス流量、終点ガス流量、ガス安定時間を設定する。
   (ガス安定時間は 5~10 秒くらいでよい。)
- 4. 測定するイオン電流(イオン電流1 or イオン電流2)を設定する。
   (通常はイオン電流2。)
- 5. チャンバー内圧力が 10<sup>-4</sup> Pa 以下であることを確認し、開始ボタンを押し、測定を開始する。
- 6. 測定終了後、プロットされたガス流量-イオン電流曲線からピーク値の 70~80 %の位置のマーカーをダブ ルクリックする。
- 7. 登録するモードをチェックし、登録ボタンを押す。





研磨操作

- 1. 操作画面研磨を選択する。
- ベルトの未使用面が出るように1度送りを押す。(1度使用した箇所は弱っているので、使用しない。送 りを34回押すとベルトは1回転する。そしたらベルト=3万の交換。)
- ・傾斜モードを[傾斜]の中より選択する。

   (無、片方、双方があるが、特に理由がなかったら双方を選択。無では穴はたぶん開かない。)
- 4. 傾斜角度を[イオン角度]で設定する。
   (0~6°の範囲で設定可能、角度が大きいほど試料の上のほうに穴が開く。2.5°くらいが適度らしい。)
- 5. 傾斜間隔を[切替間隔]で設定する。
   (イオン照射中の試料を傾斜させる時間。30 秒が
   目安だと思う。)
- 6. 開始ボタンを押し、イオンビーム照射を開始する。
   (イオン電流は 80 µ A 位がいい。)

(4)

仕上げ(やってもやらなくてもどちらでもいい。)

- 1. 操作画面仕上げを選択する。
- Ar ガス流量を研磨時+0.2~0.4、加速電圧を 2~3 kV (2 kV 程度が良いらしい。)、イオン角度を研磨時+0.5°に設定する。
- 3. ミリング時間は 5~10 分を目安に設定する。
- 4. 開始ボタンを押し、イオンビーム照射を開始する。

立ち下げ

1. 本体正面右下の電源を切る。

(立ち下げ後 20 分は TMP が動いているので、装置は移動させない。)

2. 終わり。